

KOSAKA LAB ET 150**微观形状测定机（探针接触式台阶仪）**

株式会社小坂研究所（KOSAKA）是于 1950 年创立的公司，也是日本第一家发表光学杠杆表面粗糙度计，是一家具有悠久历史与技术背景的专业厂商，主要有测定/自动/流体三大部门。其中测定部门为最具代表性单位且在日本精密测定业占有一席无法被取代的地位。

设备特点：

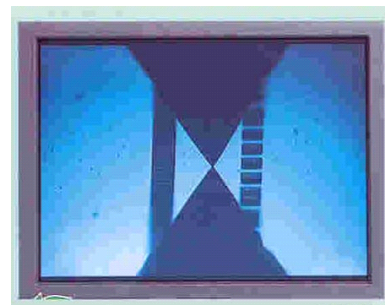
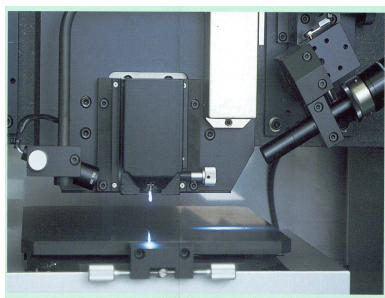
KOSAKA ET 150 基于 Windows XP 操作系统为多种不同表面提供全面的形貌分析，包括半导体硅片、太阳能硅片、薄膜磁头及磁盘、MEMS、光电子、精加工表面、生物医学器件、薄膜/化学涂层以及平板显示等。使用金刚石（钻石）探针接触测量的方式来实现高精度表面形貌分析应用。ET 150 能精确可靠地测量出表面台阶形貌、粗糙度、波纹度、磨损度、薄膜应力等多种表面形貌技术参数。

ET 150 配备了各种型号探针，提供了通过过程控制接触力和垂直范围的探头，彩色 CCD 原位采集设计，可直接观察到探针工作时的状态，更方便准确的定位测试区域。



※パソコンラック、プリンタ、防護蓋はオプションです。

 **Kosaka Laboratory Ltd.**



上海纳腾仪器有限公司 **Shanghai NTI Co., Ltd.**
Tel: 021-64283335 www.shnti.com admin@shnti.com

规格

一、测定工件:

1. 最大工件尺寸: $\phi 160\text{mm}$
2. 最大工件厚度: 50mm
3. 最大工件重量: 2kg

二、检出器 (pick up) :

1. Z方向测定范围: $\text{Max. } 600\mu\text{m}$
2. Z方向分解能: 0.1nm
3. 测定力: $10\text{uN} \sim 500\text{uN}$
4. 触针半径: $2\mu\text{m}$
5. 驱动方式: 直动式
6. 再现性: $1\sigma = 1\text{nm}$ (实际测试可达 0.2nm 以下)

三、X 轴 (基准轴):

1. 移动量(最大测长): 100mm
2. 移动的真直度: $0.2\mu\text{m}/100\text{mm}$
3. 移动,测定速度: $0.005 \sim 20\text{mm/s}$
4. 线性尺(linear scale): 分解能 $0.1\mu\text{m}$

四、Z轴:

1. 移动量: 50mm
2. 移动速度: $\text{max. } 2\text{mm/S}$
3. 检出器自动停止机能
4. 位置决定分解能: $0.1\mu\text{m}$

五、工件台:

1. 工件台尺寸: $\phi 160\text{mm}$
2. 机械手动倾斜: $\pm 2^\circ$ ($\pm 1\text{mm}/150\text{mm}$)

六、工件观察: $\text{max. } 110$ 倍(可选购其它高倍率CCD)

七、床台: 材质为花岗岩石

八、防振台(选购): 落地型或桌上型

九、电源: $\text{AC } 100\text{V} \pm 10\%$,
 $50/60\text{HZ}$, 300VA

十、本体外观尺寸及重量:

$\text{W } 500 \times \text{D } 440 \times \text{H } 610\text{mm}$, 120kg

(不含防震台)